

液晶製造工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替 (I001)

【プロジェクト概要】

液晶製造のエッチング工程で用いられるSF6を主成分とするガスを、COF2を主成分とするガスに代替することで、SF6(地球温暖化係数23900)の使用を削減する

【プロジェクトの適格性基準】

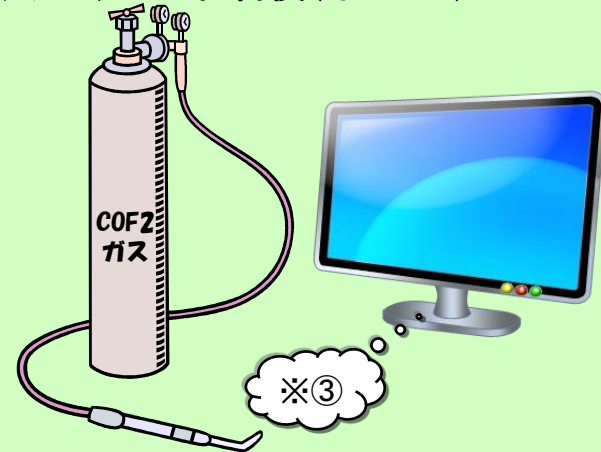
- 条件1. エッチング工程で使用するガスをCOF2を主成分とするものに代替することにより、SF6の使用量が削減されること
- 条件2. 過去1年間にわたりSF6を主成分とするエッチングガスの消費量及びアレイ工程終了後のマザーガラス製造数の記録が完備しており、プロジェクト実施前後で製造品目や工程等の大幅な変更を行わないこと
- 条件3. プロジェクトの採算性がない、又は他の選択肢と比べて採算性が低いこと。

排出削減量の算定で考慮する範囲

<エッチングガス代替前(イメージ)>



<エッチングガス代替後(イメージ)>



※【排出削減量算定のために必要なモニタリング項目】

- ①過去1年間のSF6ガスの使用量(購買データ、または実測データ)
- ②プロジェクト実施前の過去1年間に製造されたアレイ工程終了後のマザーガラス製造量(工程通過枚数の管理データ)
- ③プロジェクト実施後のアレイ工程終了後のマザーガラス製造量(工程通過枚数の管理データ)